## Влияние дефектов на сегнетоэлектрические свойства HfO<sub>2</sub>:La

<u>Залялов Т.М.<sup>1,2</sup>, Исламов Д.Р.<sup>1,2</sup>, Орлов О.М.<sup>3</sup>, Гриценко В.А.<sup>1,2</sup></u>

<sup>1</sup>ИФП СО РАН, 630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 13 <sup>2</sup>Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 <sup>3</sup>НИИМЭ, 124460, Зеленоград, улица Академика Валиева, 6/1



Оксид гафния уже больше десятилетия используется в микроэлектронике в качестве подзатворного диэлектрика. После открытия сегнетоэлектрических свойств в тонких пленках оксида гафния, стало возможным их применение в сегнетоэлектрической памяти – ferroelectric random-access memory (FeRAM). Данный тип памяти является энергонезависимым и энергоэффективным, что делает его привлекательным для использования в мобильных устройствах и компьютерах. Пленки оксида гафния имеют дефекты, которые могут влиять на сегнетоэлектрические свойства. В данной работе были проведены измерения вольт-амперных характеристик и моделирование транспорта заряда для изучения эволюции поляризации и концентрации дефектов в процессе циклирования – последовательных циклов переключения поля в пленках.

Фонон-облегченное туннелирование между ловушками

H 2020

Для диэлектриков с высокими концентрациями ловушек основной вклад в перенос заряда

дает эффект туннелирования между ловушками. Вероятность туннелирования:

$$P = \int_{\varepsilon>0} \frac{\hbar|\varepsilon|}{m^* a^2 k T Q_0} exp\left(-\frac{(Q-Q_0)^2 - (Q-eFa/Q_0)^2}{2kT} - \frac{4}{3} \frac{\sqrt{2m^*}\left((-\varepsilon)^{3/2} - (-\varepsilon - eFa)^{3/2}\right)}{eF\hbar}\right) dQ,$$

$$\varepsilon = -Q_0(Q-Q_0) - W_{opt}, \qquad Q_0 = \sqrt{2(W_{opt} - W_t)}.$$



 $U_{\rm b}(Q)$ 

lovosibirsk

Здесь  $\varepsilon$  – энергия локализованного электрона,  $\hbar$  – постоянная Планка,  $m^*$  – эффективная масса носителя заряда (электрона), a – расстояние между ловушками, k – постоянная Конфигурационная диаграмма туннелирования электрона между фонон-связанными ловушками.  $U_b(Q)$  – потенциальная энергия ловушку электрона и фононов,  $Q_0$  – конфигурационная координата, характеризующая электрона и фононов,  $Q_0$  – конфигурационная координата, характеризующая электронов взаимодействие,  $W_{opt}$  – оптическая энергия ионизации (прямым энергия свободного электрона. Горизонтальная линия отражает переходом),  $W_t$  – термическая энергия ионизации (минимальная энергия, требуемая для

освобождения электрона) *F* – напряженность электрического поля.

## [K.A. Nasyrov and V.A. Gritsenko, J. Appl. Phys. 109, 093705 (2011)]

## Эксперимент

На образец подавалась последовательность импульсов положительного и отрицательного напряжения амплитудой 2.5 В – циклирование (а). Длительность нарастания импульса t<sub>1</sub> составляла 8 нс, время подачи напряжения t<sub>2</sub> и паузы между импульсами t<sub>3</sub> равны и составляли 5 мкс. На некоторых циклах

производились измерения PUND (Positive-Up-Negative-Down) методом (б). Данные измерения заключаются в подаче на образец двух положительных и двух отрицательных импульсов напряжения амплитудой 2.5–3.5 В. Было произведено 4000 измерений за полный PUND-цикл за время 21.6 с.

Токи утечки были получены путем усреднения токов, текущих при нарастании и снижении напряжения, подаваемого в импульсе Up или Down:



 $I_{leakage}^{U}(V) = 1/2 \left( I_{0 \to +V}^{U}(V) + I_{+V \to 0}^{U}(V) \right),$ 

 $I_{leakage}^{D}(V) = 1/2 \left( I_{0 \to -V}^{D}(V) + I_{-V \to 0}^{D}(V) \right)$ 



## Результаты

На рисунках для двух образцов (a, б) представлены слева направо: зависимости плотностей токов утечки от прикладываемого к структуре напряжения; зависимости поляризации от напряжения, прикладываемого к образцу, для разных циклов переключения поля; значения двойной остаточной поляризации в процессе циклирования.

